#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04260358 A

(43) Date of publication of application: 16.09.92

(51) Int. CI

H01L 23/28 H01L 21/56

(21) Application number: 03022337

(22) Date of filing: 15.02.91

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

HIRUTA YOICHI YAMAJI YASUHIRO

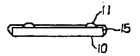
# (54) ELECTRONIC DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

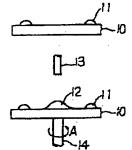
#### (57) Abstract:

PURPOSE: To achieve a miniaturized package and a high reliability.

CONSTITUTION: A title item is provided with a semiconductor chip 10, a bump 11 corresponding to an external connection terminal which is electrically connected to an electrode of the semiconductor chip 10, and a resin 15 corresponding to an envelop which seals the semiconductor chip 10 and the resin 15 is formed to be approximately 0.5mm or below in thickness.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio





99-5/094

### (19)日本国符許庁(JP)

# (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開会号

特開平4-260358

(43)公開日 平成4年(1992)9月15日

(51) Int.Cl.4

資別記号 庁内空理番号

Fi

技術表示医所

HO1-L 23/28

..

Z 8517-4M

21/56

E 8617-4M

審査請求 未請求 請求項の数17(全 7 頁)

(21)出顧番号

**特顯平3-22337** 

(22)出類日

平成3年(1991)2月15日

(71)出類人 000003078

朱式会社京芝

神奈川県川崎市幸区堤川町72番地

(72) 発明者 矩 田 陽 一

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 株式会

社東芝総合研究所內

(72) 発明者 山 地 秦 弘 -

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会

社束艺能合研究所内

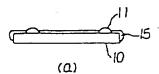
(74)代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

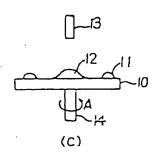
# (54) 【発明の名称】 電子装置及びその製造方法

#### (57) 【要約】

【目的】 バッケージの小型化と、高い信頼性の実現を図る。

【構成】 半導体チップ10と、半導体チップ10の飛煙に電気的に接続された外部接続端子に相当するバンプ11と、半導体チップ10を封止する外囲器に相当する 附加15とを備え、この樹脂15は厚みが約0.5m以下に形成されている。





# 【特許請求の範囲】

【講求項1】電子部品と、前記電子部品の電極に電気的に接続された外部接続端子と、前記電子部品を封止する外国器とを備え、前記外国器は、厚みが約0.5m以下であることを特徴とする電子装置。

【請求項2】半導体テップと、前記半導体テップの電極に重気的に接続された外部接続端子と、前記半導体テップの面のうち、少なくとも前記重極が形成されている姿面であって、前記外部接続端子が接続されている部分を、除いた領域を封止する外囲器とを備え、前記外囲器は、厚みが約0.5m以下であることを特徴とする電子装置。

【請求項3】 半導体チップと、前記半導体チップの電極に電気的に接続された外部接続端子と、前記半導体チップの面に取り付けられた放熱フィンと、前記半導体チップの面のうち、少なくとも前記電極が形成されている部分と面であって、前記外部接続端子が接続されている部分と前記放熱フィンが取り付けられている部分とを除いた領域を封止する外囲器とを備え、前記外囲器は、厚みが約0、5 m以下であることを特徴とする電子装置。

【請求項4】前記外部技統端子は、パンプにより形成されているものであることを特徴とする請求項1ないし3に記載の電子装置。

【請求項5】前記外田器は、有規樹脂から成るものであることを特徴とする請求項1ないし4に記載の電子装置

【請求項 6 】前記有機樹脂には、無機材料が含まれていることを特徴とする請求項 5 記載の電子装置。

【請求項7】前記半導体チップを搭載する基板をさらに 傾えることを特徴とする請求項1ないし6に記載の電子 30 装置。

【調求項8】前記基板には、少なくとも一層の配線層が 形成されていることを特徴とする調求項7記載の電子芸 受

【請求項9】前記外囲器は、U字型断面形状を有し、前記載子部品を内部底面に軽置するものであり、前記外囲器の上面は薄板で封止されていることを特徴とする請求項1記載の載子設置。

【請求項10】前記外国器は、U字型新面形状を有し、前記半導体チップを内部底面に載置するものであり、前 40 記外国器の上面は薄板で封止されていることを特徴とする請求項2記載の電子装置。

【請求項11】半導体チップの電極上にバンプを形成する第1の工程と、前記半導体チップの表面のうち、前記パンプが形成されている部分を除いた前域に液状閉鎖を始而し、固化させることによって封止する第2の工程とを備えたことを特徴とする電子装置の製造方法。

(請求項12)前記第2の工程において、前記液状樹脂 たポリイミドフィルム930の空布は、回転中の前記半導体チップの表面上に前記液 形成された半導体チップ9 状樹脂を流出させることによって行うことを特徴とする 50 ント配職基板に実展される。

基子装置の製造方法。

【調求項13】半導体デップの電極上にバンプを形成する工程と、外部接続端子を有する基板に、この外部接続端子と前記パンプとを電気的に接続した状態で前記半導体デップを搭載する工程と、前記基板に搭載された前記半導体デップの表面を、液状樹脂を塗布し固化させることにより、厚さが約0.5m以下の外国器で封止する工程とを備えたことを特徴とする電子装置の製造方法。

【請求項14】半導体チップの電極上にバンプを形成する第1の工程と、外部接続端子を有し、厚みが約0.5 m以下であってU字型断面形状を有する外国器の内部底面に、前記外部接続端子と前記バンプとを意気的に接続した状態で前記半導体チップを搭載する第2の工程と、前記外国器の上面を、板厚が約0.5 m以下の薄板で封止する第3の工程とを備えたことを特徴とする電子装置の製造方法。

【請求項15】前記第3の工程において、前記外臣器の内部に不活性ガスを充填した状態で、前記外田器の上面を前記簿板で封止することを特徴とする請求項14記数20の電子装置の製造方法。

【請求項16】前記第3の工程において、前記外無器の内部に還元性ガスを売填した状態で、前記外囲器の上面を前記簿板で封止することを特徴とする請求項14記載の電子装置の製造方法。

【額求項17】半導体チップの電極上にバンブを形成する工程と、前記半導体チップの表面のうち、前記バンブが形成されている部分を除いた領域に液状樹脂を塗布し、固化させる工程と、固化された前記樹脂のうち所定箇所を除去し、前記半導体チップの表面を部分的に禁出させる工程と、露出した前記半導体チップの表面に、放然フィンを取り付ける工程とを偏えたことを特徴とする電子装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子装置及びその製造方法に係わり、特に電子部品の封止循道に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体チップ等の電子部品は、樹脂等により封止された状態でプリント配線を放上に実度される。例えば、図7に示されたものは、半導体チップ71のパッドがリードフレーム73にワイヤ72によって検験された状態で、樹脂70により封止されたほ違となっている。図8では、半導体チップ81がリードフレーム82にポンディングワイヤ83により接続された状態で、セラミックパッケージ85によって対止されている。また図9に示されたようなTABによる実装されたポリイミドフィルム93に、パッド上にパンプ91が形成された半導体チップ90が接合された状態で、プリント配置基準に事業される。

【0003】 最近では、テップオンポード (COB) と 称される実装も存在する。これは図10(a)及び (b) に示されるように、セラミックやガラスエポキシ **樹脂等から成る基板101の両面に、バッド上にバンブ** を形成された半導体チップ102が直接実装される。ま た図11のように、配線層が多層に傾倒されたセラミッ ク基板 ししし上に半導体テップ112 が実装されたもの も存在する。あるいは、図12に示されたようにフレキ シブル樹脂121上に半導体テップ122が搭載された ものも用いられている。これらのバッケージ構造に関し ては、以下の文献に記載されている。

【0004】1) 二瓶公志 他編: 半導体実装技術八 ンドブック、pl17,Pl42 (株)サイエンスフォーラム、 昭和61年。

[0005]2) (垛) 日立制作所半等体事業所編; 表面実装形LSI パッケージの実装技術とその信頼性向 上, p33 応用技術出版, 1989年.

3) Microelectronics Packaging Handbook . P368. e d. by Rav R. Tummale and Fugine J. Rymaszcwski. Yan Ma strandReinhold, 1989.

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従 来の電子装置には次のような問題があった。先ず、半導 体チップ等を封止する工程に時間がかかることが挙げら れる。また、近年のデバイス技術の進歩により実現され るに至った高機能集積回路では、500ピン以上という ような多数の端子を必要とする。このため、バッケージ が大型化し製造が困難になりつつある。TABによる実 **蓑では、このパッケージの大型化を抑制する効果がある** 程度得られるが、それでもパッケージの寸法は半導体チ ップの1.5~3倍を必要とする.

【0007】このような問題を解決するために、上述し たCOB実装が考案され、試験的に用いられ始めてい る。ところが、この実装方法では基板に実装するまでの 間、半導体テップを全く封止していない状態で保養しな ければならない。このため、半導体チップに水分や魔染 等が侵入して信頼性が低下する問題があった。また基板 に実装した後で、半導体チップの表面をポッティング財 旧により封止するが、基板と閉箱との間に隙間が存在 し、やはり水分等の侵入を防ぐことはできなかった。。 【0008】 本発明は上記事情に 強みてなされたもの で、バッケージの小型化が可能で、かつ信頼性が高い電 子芸園及びその製造方法を提供することを目的とする。

 $\{00009\}$ 

【課題を解決するための手段】本発明の君子装置は、並 子節品と、粒子部品の重極に重気的に接続された外部技 統漢子と、粒子部品を封止する外囲器とを導え、外囲器 は呼みが約0. 3 皿以下であることを特徴としている。

【0010】 菓子記品として半導体テップを有し、この 半導体チップの電極に柔気的に接続された外部複統第子 30 した状態で外国器の上面 を薄板で封止するのが好まし

と、半導体チップの面のうち、少なくとも意識が形成さ れている表面であって、外部伝統端子が接続されている 部分を除いた領域を封止する外国器とを備え、この外国 器の厚みが約0. 5m以下であるものであってもよい。

【0011】半導体テップと、半導体テップの金銭に含 気的に接続された外部接続端子と、半導体チップの画に 取り付けられた放熱フィン と、半導体テップの菌のう ち、少なくとも重極が形成されている表面であって、ま 部接続端子が接続されている部分と放熱フィンが取り付 10 けられている部分とを除いた領域を封止する外国器とを 備えており、この外囲器は厚みが約 0. 5 出以下である ものであってもよい。

【0012】外部接続端子は、パンプにより形成されて。 いるものであってもよい。

【0013】外囲器は、有機樹脂から成るものであって

【0014】そして有機樹脂には、無機材料が含まれて いるのが好ましい。

【0015】半導体チップを搭載する基版をさらに購え 20 ることもできる。

【0016】そして基板には、少なくとも一層の配象層 が形成されていてもよい。

【0017】外田器は、電子部品又は半導体テップを内 部底面に載置するU字型断面形状を有するものであり、 外囲器の上面は、薄板で封止されているものであっても

【0018】本発明の電子装置の製造方法は、半導体テ ップの電極上にバンプを形成する第1の工程と、半導体 テップの表面のうち、パンプが形成されている部分を除 いた領域に液状樹脂を塗布し、固化させることによって 封止する第2の工程とを備えたことを特徴としている。

【0019】この第2の工程において、波状樹脂の資布 は、回転中の半導体チップの表面上に液状樹脂を読出る せることによって行ってもよい。

【0020】また本発明の製造方法として、半導体デッ プの電極上にバンプを形成する工程と、外部接続端子を 有する基板に、この外部技統第子とパンプとを意気的に 接続した状態で半導体テップを搭載する工程と、基板に 搭載された半導体チップの表面を、液状樹脂を登布し型 40 化させることによって形成した厚さ 0. 5 四以下の外国 器で封止する工程とを備えた方法であってもよい。

【0021】半導体チップの電腦上にパンプを形成する 第1の工程と、外部接続端子を有し、厚みが約0.50円 以下であってU字型断面形状を有する外国器の内部底面 に、外部接続第子とパンプとを重気的に接続した状態で 半導体チップを搭載する第2の工程と、外回器の上面 を、板厚が約0. 5 皿以下の薄板で封止する第3の工程 とを窺えた方法でもよい.

【0022】ここで、外四器の内部に不活性ガスを元頃

【0023】あるいは、外田器の内部に退元性ガスを充 這した状態で、外囲器の上面を薄板で封止してもよい。

【0024】半導体チップの重複上にパンプを形成する 工程と、半導体テップの表面のうち、バンプが形成され ている部分を除いた領域に波状樹脂を塗布し、面化させ る工程と、固化された樹脂のうち所定箇所を除去し、半 導体チップの表面を部分的に募出させる工程と、募出し た半導体テップの表面に、放然フィンを取り付ける工程 とを備えた方法により、本発明の電子装置を製造するこ 10 構造を有する点に特徴がある。 ともできる.

#### [0025]

【作用】 電子部品が外囲器により封止されており、その 厚さは約0.5回以下であるため、多数の第子を有する 場合にも、電子部品よりわずかに大きい程度の大きさに 抑えることができる。また電子部品が外国器により封止 された状態にあるため、水分等の侵入が防止され、高信 領性が確保される。さらに、外囲器の厚みが薄いことか ら、外部接続端子の短縮化が可能であり、これにより端 子のインダクタンスやキャバシタンスが低減される。

【0026】電子部品として半導体テップを用いた場合 にも、同様に外囲器の小型化、高信頼性の確保、外部署 子の短縮化が可能である。

【0027】半導体テップの面に放然フィンを取り付け た場合には、放然性が向上する。

【0028】外部接続端子としてパンプを用いた場合に は、より小型化を図ることができる。

【0029】外囲器を有機樹脂により形成することがで きる。この有機樹脂に無規材料が含まれていると、熱抵 抗が低下し、放熱性が向上する。

【0030】半導体チップが基版に搭載されている場合 には、強度性が向上する。

【0031】この基板に配線パターンが形式されている 場合には、半導体デップの電極と外囲器の外部接続端子 との位置が一致していなくともよい。このため、国路設 計に変更があった場合にも、基板の配線パターンを変更 することで、既存の半導体チップを応用することができ

【0032】U字型断面形状を有する外囲器と薄板で、 電子部品又は半導体チップを封止した場合には、高い強 40 度性が得られる。

【0033】以上のような本発明の電子装置は、パンプ を形成する第1の工程と、樹脂を塗布して固化させる第 2の工程とを備えた本発明の製造方法を用いることによ って製造することができ、工程数の減少、工程時間の短 常化がもたらされる.

【0034】ここで、半導体チップ表面に樹脂を墜布す る際に、半導体チップを回転させて行うと均一な厚さの 外国器が得られる。

導体チップを封止する場合に、内部に不后性ガスを充填 させることで、辛等体テップに腐食が起こるのを防止す ることができる。遺元性のガスを売頃させた場合には、 特にバンブの腐食をより効果的に防止することができ Õ.

#### [0036]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図面を参照。 して説明する。 本実施例による電子芸置は、厚さが 0. 5 ma以下の外囲器に半導体チップを封止したパッケージ

【0037】図1(a)に第1の実施例による電子装置 のパッケージ構造を示す。半導体テップ10のパッド上 にパンプ11が形成されており、その表面が有機系術脂 からなる外囲器15により覆われている。

【0038】この電子装置は、次のような方法により製 通される。先ず図1(b)のように、半導体テップ10 のバッド上に、高さが70~150㎜になるようにパン プ11が形成される。この後、図1(c)のように半導 体チップ10が真空チャック14上に搭載される。 真空 20 テャック14によって、半苺体チップ10が矢印Aの方 向に1000~6500 rps の回転数で回転し、ノズル 13からは粘度が約1.5Pa\_Sのポリイミド

製造が旋出 してスピンコートされる。」これにより、半導体テップ1 0の表面には、ポリイミド樹脂から成る外国器15が5  $\sim 50 \mu$ mの厚さに形成される。

【0039】ここで、外囲器15にはエポキシ樹脂やシ リコン樹脂、あるいはポリフェニレンサルファイドを用 いてもよい。またこれらの有機樹脂に、溶融石英やアル ミナ、窒化アルミニウム等の無機材料を含ませると、熱 抵抗が減少し放熱性が向上する。

【0040】図2に、本実施例による第2の実施例を示 す。第1の実施例では、半導体チップの表面及び側面が 外囲器で凝われていた。これに対し第2の実施例では、 半導体テップ10のパンプ21が形成された表側と側面 だけでなく、裏面側も含む全面が外囲器22により封止 されている。

【0041】この装置は、次のような方法により製造さ れる。 図 2 (b) に示されたように、半導体テップ 2 0 のパッド上にパンプ 2 1 が形成される。 図 2 (c) のよ うに、半導体テップ20の裏面倒が真空テャック23に より固定され、スピンコートが行われて謝脂 2 <u>2 a で表</u> 例が封止される。この後、図2(d)のように半導体デ ップ20の妻側が冥空チャック23で固定され、裏面新 が樹相226で封止される。この樹粕22a及び22b から成る外囲器22により、半導体チップのパンプ2! 以外の全面が封止される.

【0042】本発明の第3の実施別は、図3に示される ように放然フィンが設けられている。半導体チップ30 のパンプ31が形成されていない異面劇のうち、中央に

30

放熱フィン34が取り付けられ、半導体チップ30から 発生した然が放然されるようになっている。

【0043】この実施例では、半導体チップ31のパン プを除く全面を掛脂32で展った後裏面側の中央部分を 除去し、放然フィン34をAu・Ge系半田かポリイミ ド系接着剤により矢印Bの方向に取り付けることによっ て製造することが可能である(図3(b))。あるい は、図3(c)に示されたように、半導体テップ30の 裏面側に予め放然フィン35を取り付けた後、スピンコ ートを行って樹脂32a及び32bで覆ってもよい。

【0044】図4(a)に、本発明の第4の実施例によ る装置の構造を示す。本実施例では、半導体チップ41 が基版40に接合されており、強度性が向上している。 差板40には、有機材料の他に、酸化アルミニウム(A 12O3), 空化アルミニウム(AIN), アルミニウム (Al)、鉄(Fe)等の金属を用いることが可能であ る. 基板40に接合された半導体チップ41の表面を、 ポッティング樹脂43が覆って封止している。

【0045】この実施例における製造方法は、次のよう である。図4(b)のように、基版40上にポリイミド 20 不活性ガスの代わりに遠元性のガスを用いた場合には、 系の接着剤により半導体デップ41が接合され、基版4 0が其空チャック44で固定される。この状態で、ノズ ル45からポッティング樹脂が流出して半導体デップ4 1の姿側が覆われる。

【0046】ここで、基版40は半導体チップ41と同 一の大きさにすることもできる。しかし、この図4に示 されているように、半導体テップ41よりもやや大きく した方が、より確実に半導体チップ41を樹脂43で封 止することができる。

【0047】四5 (a) に、本発明の第5の実施例によ 30 る装置のパッケージ構造を示す。基板50の表面に接続 用パッド51が形成されており、この部分には穴52が 開孔されている。そして半導体チップ53のバンプ54 と、 基板 5 0 の穴 5 2 の位置とが一致するように、 基板 50に半導体チップ53が実装される。この状態で、ポ ッティング樹脂から成る外囲器57によって、半導体テ ップ53が封止されている。

- 【0048】この装置を製造する方法は、次のようであ る、図5(b)のように、先ず半導体テップ53の表例 が、基板50のバンブ51が形成されていない面に実装 40 される。この状態で、容器55ヘ半導体チップ53が矢 印Cの方向に入れられ、表面に樹脂56が黛布される。 この樹脂 5 6 には、1. OPa. S程度の低粘度の樹脂を用 いることができる。COB実装では、このような低粘度 の樹脂を用いることは難しい。しかし本表施例では、半 導体テップ53がプリント配線基板に実装されていない。 状態で強布されるため、低粘度の樹脂を用いることがで き、隙間のない確実な封止が可能となる。

【0049】図6(a)に、本発明の第6の実施例を示 す。 U型の断面形状を育する外四器 6.2 の表面に接続用 30 端子の長さを大幅に足捨することができる。この結果、

パッド63が形成されており、接続用パッド63の形成 された位置に六64が開孔されている。この外三器62 の底面に、穴64とパンプ61の位置が一致するよう に、半導体テップ60が搭載されている。外囲器62の 上面は、金属から成る薄板65が圧着されて封止されて いる。外囲器62には、例えば厚さ0、5㎜の熱硬化性 樹脂やセラミック等を用いることができる。 薄板65に は、厚さ O. lamのアルミニウム(Al)や、剝(Cu )、鉄(Fe)、Ni (ニッケル)、あるいはこれら 10 の合金の使用が可能である。

【0050】本実施例による電子装置は、次のようにし て製造される。図6(b)に示されるように、外回器6 2の底面に半導体チップ60が載置される。図6 (c) のように、外国器 6 2 の端部 6 2 a が台 6 7 に固定され る。この状態で、この端部62aと薄板65とに、圧接 用ツール106によって圧力が加えられて、圧着され る。ここで、外囲器62と薄板65で封止された内部空 間に、不活性ガスを充填させた場合には、半導体チップ の配線層等に腐食が生じるのを防止することができる。 バンプの腐食防止により大きな効果が得られる。

【0051】このように、第1実施例ないし第6の実施 例は、いずれも外部接続用の端子が設けられ、厚さが薄 い外囲器によって半導体チップが封止されている点に特 徴がある。このため、従来の登予装置が抱えていた。パ ッケージ寸法の大型化や、封止工程時間の増大、封止さ れていない半導体チップに水分等が侵入することによる 信頼性の低下といった問題が、全て解決される。

【0052】先ず上述した実施例では、外囲器の表面 に、半導体デップのバッドが奪出しているか、あるいは このパッドと同一位置に、外部接統用のパッドが設けら れている。このため、外囲器の大きさを半導体テップよ りわずかに大きい程度に抑えることが可能である。例え ば、500ピンを有するセラミックバッケージでは5co 四方の大きさになる。これに対し本実施別によれば、同 等の機能を有する装置を1.5cm~2.0cm四方の大き さで提供することができる。

【0053】また本実施例による方法で位于装置を製造 した場合には、半導体チップのバッド上へのバンブの形 成と、樹脂による封止とで基本的な製造が可能であるた め、工程時間が短縮される。

【0054】従来のCOB実装では、半導体チップを基 板に直接実装するため寸法の増大を抑制することはでき るが、実装までの間に水分等が投入し信頼性が損なわれ るという問題があった。これに対し、本実施例では半導 体テップが封止されるため、高い信頼性を確保すること ができる。

【0055】さらに本実施例では、半導体テップを封止 する外国器の厚みが薄いため、従来のパッケージよりも

10

リードのインダクタンスやキャバシタンスが低減され、 高速動作が可能となる。

【0056】また図5に示された第5の実施例では、基 版50に回路パターンを形成することで、半導体チップ 54のパッドと異なる位置に基板50にパンプ51を形成することができる。これにより、設計変更が生じた場合にも基板50に設けるパンプ51の配置を変えるのみで、既存の半導体テップ53を流用することが可能となり、コスト低減が達成される。

【0057】上述した実施例はいずれも一例であり、本 10 発明を限定するものではない。例えば、実施例では半等体チップを封止していたが、トランジスタや抵抗体等の電子部品を封止するものであってもよい。

#### [0058]

【発明の効果】以上説明したように本発明の電子装置は、電子部品が厚さが約0.5 m以下の外囲器により封止されており、多数の端子を有する場合にも電子部品よりわずかに大きい程度の大きさに抑えることができ、また電子部品が外囲器により封止された状態にあるため、水分等の侵入が防止されて高信頼性の確保が可能である。さらに、外囲器の厚みが薄いことから外部接続端子の短路化が可能であり、これにより端子のインダクタンスやキャバシタンスが低減され、動作の高速化を図ることができる。

【0059】またこのような電子装置は、基本的にバンプ等の外部接続端子の形成と、樹脂等による封止とを行う本発明の製造方法を用いて製造することができ、工程数の減少及び工程時間の短縮化が達成される。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例による電子装置のパッケ 30 ージ構造及びその製造方法を示した工程別経断面図。

【図2】本発明の第2の実施例による電子装置のバッケ

ージ構造及びその製造方法を示した工程別総断面図。 【図 3】 本発明の第3の実施列による電子装置のパック

ージ構造及びその製造方法を示した工程別総断面図。

【図4】本発明の第4の実施例による電子装置のバッ! ージ接待及びその型持方法を示した工器別解時間図

ージ構造及びその製造方法を示した工程別総新面図。 【図 5】 本発明の第5の実施例による電子装置のバッ!

ージ構造及びその製造方法を示した工程別段断面図。 【図 6】 本発明の第 6 の実施例による電子装置のバッ?

ージ構造及びその製造方法を示した工程別総新面図。 【図 7】 従来の電子装置のパッケージ構造を示した料:

断面図。 【図 8】従来の電子装置のパッケージ構造を示した袋!

回図。 【図9】従来の電子装置のバッケージ構造を示した築計

面図。 【図10】従来のCOB実装方法による電子長置のパ

ケージ構造を示した斜視図。 【図11】従来のCOB実装方法による並子装置のバ

7 【図12】従来のCOB実装方法による電子装置のパケージ構造を示した斜視図。。

【符号の説明】

10 半導体チップ

11 パンプ

12 ポッティング樹脂

ケージ構造を示した斜視図。

13 ノズル

14 真空テャック

15 外国器

3.4 放热フィン

0 40 基板

65 薄板

66 圧接用ツール

